

侵害判断の手法に見る意匠権と著作権の相違(その2)

——意匠権侵害判断における全体印象観察の特色をめぐって

国土館大学 法学部 教授 本山雅弘

I. はじめに

本誌125号の「その1」では*1、意匠権侵害の判断手法における特色を、①要部認定および当該要部に関する原告意匠・被疑侵害意匠の対比、②要部以外の構成を含めた両意匠(形態)の共通点および相違点の全体的観察による美感類否、に求め得ると解したうえで、意匠権と著作権の双方の保護範囲の異同の一端を考察しようとの意図から、まず①に関し、要部すなわち侵害判断に際して特定される対比対象の捉え方について、著作権侵害判断の場合との比較検討を試みた。

その結果、意匠権侵害の場合には対比対象と保護要件充足要素とが必ずしも一致しない点で、著作権侵害の場合との相違を指摘できること、そして、意匠権の保護要件充足要素は、被疑侵害意匠との全体的観察を通じた最終的な類否判断の吟味の場面で、意匠の創作性の程度に即した保護範囲を画定する際に適切に組み込まれ得ると考えられることを述べた。

本稿「その2」では、前稿に続き、意匠権侵害の判断手法における上記②の特色に注目し、意匠権と著作権の双方の保護範囲の特色あるいは異同の一端を考察してみたいと思う。

すなわち具体的には、意匠権侵害の判断手法の上記②の特色(以下、これを便宜的に、「全体印象観察論」という)が、意匠法のいかなる条文構造によって支えられ、意匠権保護範囲の捉え方に関するいかなる制度的な特色と対応しているのかをまず考察したうえで、著作権法の条文構造とそこから導かれる著作権保護範囲の制度的特色に照らし、著作権の侵害判断の手法としても、意匠権侵害判断の特色をな

す全体印象観察論と同様のものが妥当するものと解し得るかを考察してみたい。

この考察を通じ、意匠権と著作権の双方の保護範囲の捉え方に関する特色が得られ、前稿から通じた基本的な問題意識である「意匠権と著作権の双方の保護秩序の異同の考察」という課題にも、資するところがあると思われる。

なお、全体印象観察論が意匠の構成要素たる無体物としての形態の類否判断の手法であることから明らかなとおり、本稿が考察する意匠権保護範囲とは、もっぱら形態に関するものである。また現行意匠法が保護対象とする建築物および画像の意匠については、その侵害判断実務に蓄積をみないことから、意識的な考察対象からは除外するが、無体物たる形態の類否に関し、意匠権の保護範囲の捉え方において本稿の示すところは、基本的に同保護対象との関係にも妥当すると考えている。

*1 本山雅弘「侵害判断の手法に見る意匠権と著作権の相違(その1) —侵害判断における対比対象の特色をめぐって」本誌125号(2020年)16頁。

II. 全体印象観察論の条文上の根拠と意匠権保護範囲の特色

1. 全体印象観察論における考慮要素の特色

意匠権の侵害判断の特色である客体たる意匠(形態)の全体印象観察論は、その判断枠組みを構成する具体的な考慮要素において、いかなる特色を指摘できるであろうか。

全体印象観察論とは、対比される意匠の形態上の共通点のみならず相違点をも踏まえたうえで、その総合的・全体的な評価により美感の印象比較を行う